

Didelės skiriamosios gebos skenuojantis elektroninis mikroskopas Quattro S

Nr.	Parametras	Reikšmė
1	Prietaisas	Skenuojantis elektroninis mikroskopas Quattro S
2	Gamintojas, kilmės šalis	Thermo Fisher Scientific, JAV
3	Patalpa	LR-66
4	Elektronų optika	Schottky lauko emisijos elektronų šaltinis Galimybė atvaizduoti visų tipų minimaliai paruoštus pavyzdžius (be padengimo, džiovinimo ir pan.)
5	Detektoriai	3 antrinių elektronų (SE) detektoriai (po vieną kiekvienam vakuumo režimui) Atgal išspinduliuotų elektronų (BSE) detektorius (nuo 500V, 4 koncentriniai + 4 kampiniai segmentai) IR-CCD kamera Navigacijos optinė kamera (≥6 MP)
6	Mėginio šaldymas	Peltier stalelis, temperatūra nuo -20°C iki 60°C, valdymas iš SEM programos / pulto
7	Pluošto pristabdymo sistema	Galimybė įkrauti laidų ar dalinai laidų mėginį iki 4 kV neigiamu krūviu, sušvelninant spindulio nusileidimo energiją ir ženkliai pagerinant kontrastą žemų įtampų režimuose
8	Vakuumo sistema	Be alyvos 3 režimai: $<6 \times 10^{-4}$ Pa 10–130 Pa 10–4000 Pa (ESEM)
9	SE skiriamoji geba	1,0 nm (30/20 kV, gilus vak.) 3,0 nm (1 kV, gilus vak.) 3,0 nm (3 kV, žemas vak.) 1,3 nm (30/15 kV, žemas vak.)
10	BSE skiriamoji geba	2,5 nm (30/15 kV, gilus/žemas vak.)
11	El. pluošto energijos diapazonas	20 eV – 30 keV
12	Maksimali pluošto srovė	≥ 200 nA
13	Mėginių stalelis	5 motorizuotos ašys (X, Y, Z, sukimasis, pakreipimas) X/Y eiga 110 mm; Z eiga 65 mm Pakreipimas 105° Laikikliai iki 16 mėginių, įvairių dydžių (iki 31,75 mm)
14	Kamera	≥340 mm pločio, ≥12 prievadų
15	Papildomi įtaisai	Plazmos valytuvas kameroje Rankinė valdymo konsolė Skystu azotu pildoma teršalų gaudyklė Mėginių krosnelė ≥160 °C Recirkuliacinis aušintuvas ≥1100 W UPS ≥6 kVA Kompresorius 230 V, ≥4 l bakas
16	EDS sistema	Skiriamoji geba 129 eV (Mn Kα) Elementų aptikimas iki Be Jutiklis: ≥30 mm²
17	EDS programinė įranga	Realaus laiko EDS rodymas SEM programoje Elementiniai žemėlapiai Linijos skenavimas Taškinis režimas

18	Papildomos programos	Panoraminių vaizdų sudarymas su offline licencija 3D rekonstrukcija + matavimai Distancinis SEM valdymas
----	----------------------	--